This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

TRAITE COOPERATION EN MATIE DE BREVETS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT	Destinataire:
101	
NOTIFICATION D'ELECTION	Assistant Commissioner for Patents
(règle 61.2 du PCT)	United States Patent and Trademark Office Box PCT
	Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date d'expédition (jour/mois/année)	The state of the s
22 juin 2000 (22.06.00)	en sa qualité d'office élu
Demande internationale no	Référence du dossier du déposant ou du mandataire
PCT/FR99/02767	F1 S26 34 B1 W01
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
10 novembre 1999 (10.11.99)	10 novembre 1998 (10.11.98)
Déposant	
PELLEGRIN, Yvon etc	
1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:	
dans la demande d'examen préliminaire internation international le:	nal présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire
23 mai 2000 (23.05.00)
	
dans une déclaration visant une élection ultérieure	déposée auprès du Bureau international le:
•	
<u></u>	
2. L'élection X a été faite	
n'a pas été faite	
avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la da à la règle 32.2b).	ite de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé
•	
·	
Bureau international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé
34, chemin des Colombettes	Antonia Muller
1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38





DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7 :

H02N 13/00, H01L 21/68

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/28654

(43) Date de publication internationale:

18 mai 2000 (18.05.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR99/02767

A1

(22) Date de dépôt international:

10 novembre 1999 (10.11.99)

(30) Données relatives à la priorité:

98/14161

10 novembre 1998 (10.11.98) F

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): SEMCO ENGINEERING S.A. [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): PELLEGRIN, Yvon [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). HERNANDEZ, José [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). CLAUDE, Richard [FR/FR]; 625, rue de la Croix Verte, Parc Euromédecine, F-34196 Montpellier cedex 5 (FR). HALE, William [US/US]; 809 Country Way, North Scituate, Massachussets, MA 02060 (US).
- (74) Mandataire: RAVINA, Bernard; Ravina S.A., 24, boulevard Riquet, Boîte postale 832, F-31080 Toulouse cedex 06 (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: ELECTROSTATIC MAINTAINING DEVICE

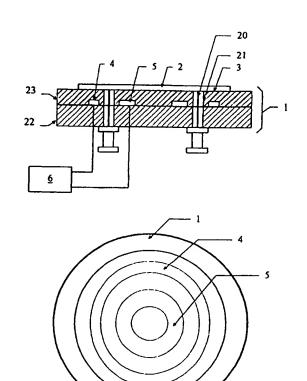
(54) Titre: DISPOSITIF DE MAINTIEN ELECTROSTATIQUE

(57) Abstract

The invention concerns an electrostatic maintaining device particularly designed for maintaining wafers made of conductor or semiconductor material such as silicon while they are being subjected to micromachining processes or any other type of treatment such as plasma treatment in a vacuum chamber for instance. The device consists of an electrically insulating surface beneath which are arranged at least two electrodes. The electrodes are powered by a direct current whereof the polarities are periodically inverted so as to release the accumulated static charges.

(57) Abrégé

La présente invention concerne un dispositif de maintien électrostatique particulièrement destiné au maintien de plaquettes de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs tels que le silicium pendant qu'elles subissent des micro-usinages ou tout autre type de traitement comme des traitements au plasma dans une enceinte sous vide par exemple. A cet effet, le dispositif est composé d'une surface électriquement isolante sous laquelle sont disposées au moins deux électrodes. Les électrodes sont alimentées par un courant continu dont les polarités sont périodiquement inversées afin de libérer les charges électrostatiques accumulées.



10

15

Dispositif de maintien électrostatique.

La présente invention concerne un dispositif de maintien électrostatique particulièrement destiné au maintien de plaquettes de matériaux conducteurs ou semi-conducteurs tels que le silicium pendant qu'elles subissent des micro usinages ou tout autre type de traitement comme des traitements au plasma dans une enceinte sous vide par exemple.

Les différentes opérations de traitement tout au long du procédé de fabrication nécessitent de maintenir solidement la plaquette de matériau sur un support. Les plaquettes sont généralement déplacées d'un poste à l'autre par des moyens automatisés.

Il est connu de maintenir la plaquette par des brides prenant appui sur la périphérie de la surface supérieure de la plaquette, mais ces systèmes présentent l'inconvénient de monopoliser une partie de la plaquette qui ne pourra pas être traitée et sera donc perdue.

Il est également connu des systèmes de maintien électrostatique dont le principe est de placer la plaquette de matériau semi-conducteur sur une surface isolante et de disposer deux électrodes sous cette surface. Les deux électrodes sont soumises à une différence de potentiel. Le champ électrique créé par ces deux électrodes engendre alors un phénomène appelé « collage électrostatique ».

Les traitements ou micro usinages réalisés sur la plaquette nécessitent une très grande précision, la plaquette doit donc parfaitement être maintenue tout au long du cycle de traitement. Cependant, lorsque le matériau semi-conducteur constituant la plaquette ou le matériau constituant la semelle est soumis à un champ électrique de même polarité pendant un certain temps, celui-ci a tendance à accumuler des charges qui

maintiendront la plaquette collée à la surface même lorsque le champ électrique extérieur ne sera plus appliqué.

Le brevet US 5452177 décrit un dispositif de maintien électrostatique sur une surface circulaire isolante sous laquelle sont placées au moins six électrodes disposées régulièrement par paires, en vis à vis par rapport au centre de la surface circulaire. Les électrodes sont alimentées par un générateur de tension alternative, fournissant six tensions différentes, chaque paire d'électrode étant alimentée cycliquement sous des polarités différentes. Les trois paires d'électrodes sont alimentées par des signaux décalés en phase de 120 degrés de manière à ce que deux paires d'électrodes soit alimentées au moment où la troisième change de polarité. Les fréquences de commutation sont de l'ordre de 30 Hz.

10

15

20

25

Pour parvenir à ce résultat, le système met en œuvre des moyens d'alimentation des électrodes très complexes et donc coûteux, d'autre part, l'utilisation de tensions alternatives induit des courants dans la plaquette qui peuvent avoir des effets néfastes lorsque la plaquette est dotée de composants électroniques.

Le brevet EP 294 556 décrit un système de maintien électrostatique constitué de deux électrodes alimentées par une tension continue. Entre chaque cycle de maintien de l'objet, les polarités des électrodes sont inversées pour libérer les charges électrostatiques. La configuration des électrodes décrites dans ce brevet (sous forme de lignes alternées) n'est pas apte à optimiser la répartition des champs dans l'objet. Ainsi, la pression de collage électrostatique risque de ne pas être uniforme sur toute la surface de l'objet. D'autre part, ce brevet est limité à la présence de deux électrodes. Il n'est donc pas possible d'inverser la polarité en cours de traitement de la plaquette car celle-ci se décollerait au moment de l'inversion de polarité. Enfin, si la durée de maintien de l'objet est

3

relativement importante, les charges électrostatiques accumulées rendront difficile son décollement

Les principales difficultés rencontrées dans le collage électrostatique résident dans le fait de réussir à la fois à obtenir un collage puissant de l'objet et à le décoller très facilement donc à éviter toute accumulation de charges pendant son maintien.

La présente invention a pour objet de proposer un nouveau dispositif de maintien électrostatique de constitution simplifié donc économiquement intéressant tout en assurant un parfait maintien des plaquettes et en évitant toute accumulation de charges pouvant gêner le retrait de la plaquette.

A cet effet le dispositif est composé d'une surface électriquement isolante sous laquelle sont disposées au moins deux paires d'électrodes, caractérisé en ce que les paires d'électrodes sont alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la plaquette.

Une autre caractéristique de l'invention réside dans la forme annulaire des électrodes. Ainsi, la pression de maintien de la plaquette est constante sur toute sa périphérie. De ce fait, la plaquette étant maintenue à tout moment sur sa périphérie, il n'y a aucun risque de déformation de celle-ci lorsqu'elle est soumise à une contrainte sur un point ponctuel de sa surface.

Selon une autre caractéristique de l'invention, la surface du dispositif de maintien présente des variations géométriques permettant de limiter la surface de contact entre la plaquette et le dispositif.

25

10

15

20

D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront à la lecture de la description ci-après de formes de réalisation de l'invention données à titre d'exemple non limitatifs et illustrés par les dessins joints dans lesquels:

- la figure 1 représente en coupe et en vue de dessus le schéma du dispositif de maintien.

- la figure 2A représente une autre forme de réalisation du dispositif de maintien avec quatre électrodes et la figure 2B une variante avec huit électrodes.

5

10

20

25

- les figures 3A et 3B représentent d'autres configurations possibles des électrodes.

Comme on peut le voir sur la figure 1, le dispositif de maintien est composé d'une semelle (1) en matériau électriquement isolant sur laquelle repose la plaquette à maintenir (2) en contact avec la surface (3). Les électrodes (4) et (5) sont disposées sous cette surface (3). Selon un mode particulier de réalisation, la semelle (1) est constituée à partir d'une plaque de base (22) sur laquelle sont disposées les électrodes (4) et (5), puis l'ensemble est recouvert d'une couche de diélectrique (23). Les électrodes (4) et (5) et la couche de diélectrique (23) peuvent être réalisées par sérigraphie de couches épaisses selon des techniques connues de l'homme de métier. L'utilisation de la technique de sérigraphie de couches épaisses dans le cas de la couche de diélectrique (23) permet de créer facilement des variations géométriques sur la surface de contact avec la plaquette. Ces variations géométriques, constituées par des aspérités ou des plots par exemple, permettent de limiter la surface de contact entre la plaquette et le dispositif de collage. Ainsi, il est possible d'obtenir la surface optimum nécessaire au bon maintien de la plaquette. En effet, quand la surface de contact est trop faible, la force de maintien n'est pas suffisante et quand la surface de contact est trop importante, il devient difficile de décoller rapidement la plaque.

La plaque de base (22) peut être réalisée en tout type de matériau diélectrique c'est à dire électriquement isolant. Selon un mode particulier

de réalisation de l'invention, la plaque de base (22) sera réalisée en alumine vierge. La plaque de base (22) peut également être réalisée en titane ou en molybdène. La couche de diélectrique (23) recouvrant les électrodes peut également être réalisée par tout type de matériau diélectrique à base de céramique par exemple.

La plaquette (2) est disposée à plat sur la surface (3). Selon un mode de réalisation de l'invention, les électrodes (4) et (5) sont de forme annulaire et disposées sous la surface (3) parallèlement à la plaquette. Dans cette configuration, les électrodes sont des anneaux concentriques de diamètres différents dont le centre correspond au centre de la semelle (1). La forme annulaire des électrodes est préférée puisque la plaquette (3) est de forme généralement circulaire, ce qui permet de la maintenir sur toute sa périphérie. Cependant, pour le maintien de pièces rectangulaires par exemple on pourrait imaginer les électrodes de forme correspondante. La plaquette (2) doit être disposée sur la surface (3) de manière à ce que son centre corresponde au centre des anneaux des électrodes. Afin d'obtenir une bonne répartition du champ électrique, les surfaces planes des anneaux formant les électrodes ont la même aire. L'électrode centrale (5) peut être réalisée sous la forme d'un anneau ou d'un disque. Les électrodes (4) et (5) sont soumises à une différence de potentiel par l'intermédiaire de l'alimentation (6) fournissant une tension continue de 1000 volts par exemple. Les lignes de champ créées entre la plaquette et les deux électrodes permettront le collage électrostatique de la plaquette (2) sur la surface (3). La pression de collage est proportionnelle au carré de la différence de potentiel entre les deux électrodes.

10

15

20

25

Lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique intense, les matériaux constituants la semelle (1) et la plaquette (2) ont tendance à accumuler des charges électrostatiques qui risquent de gêner le décollement de la plaquette même lorsque les électrodes ne sont plus alimentées. Cette

accumulation de charges électrostatiques est proportionnelle au temps d'alimentation du dispositif ainsi qu'à la valeur de la tension.

La plaquette reposant sur la surface (3) est généralement soulevée par des tiges (20) réparties sur sa surface pour ensuite être saisi par un bras manipulateur. Les tiges translatent verticalement dans des trous (21) traversant la semelle (1) sous l'action d'un vérin par exemple. On imagine ainsi très bien que les tiges endommageraient la plaquette si celle-ci restait collée à la surface (3).

Dans le cas d'un dispositif comportant deux électrodes et pour des procédés nécessitant un maintien de relativement courte durée, pour lesquelles la plaquette (2) n'a pas le temps de se charger, la solution consiste à inverser les polarités des deux électrodes entre chaque changement de plaquette. Ainsi, les charges accumulées par la semelle (1) pourront s'évacuer. A cet effet, l'alimentation est pourvue d'un système de changement de polarité automatique du type connu par exemple synchronisé avec le cycle d'usinage ou de traitement, à chaque fin de cycle par exemple les polarités sont inversées.

10

15

20

25

Pour des temps de traitement plus longs ou nécessitant une plus grande pression de collage, la présente invention propose d'utiliser plusieurs paires d'électrodes alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la pièce. Selon un mode possible de réalisation de l'invention présenté sur la figure 2A, les électrodes sont réalisées sous la forme de quatre anneaux concentriques (7), (8), (9) et (10) fonctionnant par paire. L'alimentation est pourvue à cet effet d'un système de polarisation et d'alimentation cyclique des électrodes. Le cycle d'alimentation et de polarisation des électrodes peut par exemple être le suivant.

De to à 11, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif.

5

10

15

20

25

De t1 à t2, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif, l'électrode (8) en positif et l'électrode (10) en négatif.

A t2 les électrodes (7) et (9) n'ont plus besoin d'être alimentées puisque les électrodes (8) et (10) ont pris le relais.

De t2 à t3 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif.

De t3 à t4 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif, les électrodes (7) et (9) sont de nouveau alimentées mais sous des polarités différentes qui permettront l'évacuation des charges.

De t4 à t5 l'électrode (7) est alimentée en négatif et l'électrode (9) en positif.

Le cycle continue ainsi durant toute la phase de traitement ou d'usinage de la plaquette.

Les paires d'électrodes désignées ci-dessus ne sont qu'un exemple pour illustrer le fonctionnement du dispositif, on pourrait tout aussi bien imaginer les électrodes (7) et (10) fonctionnant ensembles ou toute autre combinaison possible.

Selon un autre mode de réalisation représenté sur la figure 2B, chaque électrode est dédoublée, soit quatre paires d'électrode, de manière à obtenir une meilleure répartition de la pression de collage. Le cycle d'alimentation est le même que précédemment.

Selon ce principe d'inversion des polarités, la semelle peut rester maintenue indéfiniment sans accumulation de charges. De plus, comme une valeur importante de tension ne risque plus de charger la plaquette trop rapidement, les pressions de collage peuvent devenir beaucoup plus importantes.

Les temps de commutation des électrodes peuvent êtres variables suivant la tension de l'alimentation et suivant la capacité de la plaquette à se charger. A titre d'exemple pour une plaquette en silicium maintenue

sous une tension de 1000 volts, le temps de commutation optimum est d'une minute, soit une fréquence de commutation de 0.016Hz. Il est bien évident que ce temps est variable et peut être réduit à quelques secondes ou moins; cependant il est important d'éviter une commutation excessive qui endommagerait les composants de l'alimentation. D'une manière générale, la fréquence de commutation peut être comprise entre 0.01Hz et 1Hz. Les composants et le mode de réalisation de l'alimentation (6) n'ont pas besoin d'être décrits en détail puisqu'ils sont parfaitement connus de l'homme de métier. A titre d'exemple, les commutations peuvent être réalisées par des relais commandés par un automate programmable.

Le nombre d'anneaux formant les électrodes n'est absolument pas limité à quatre ou huit et leur nombre peut être bien supérieur sans que cela ne sorte du cadre de la présente invention.

10

15

20

La configuration des électrodes peut être également réalisée sous de nombreuses autres formes présentées sur les figures 3A et 3B. La symétrie et les aires égales sont les points communs à toutes les configurations possibles des électrodes. Sur la figure 3A, les électrodes (15) sont des portions de disque au nombre de quatre fonctionnant par paires en vis à vis. Le nombre de portions formant les électrodes est variable suivant les contraintes dans la semelle et la répartition de pressions de collage souhaitée. Ainsi, pour des traitements nécessitant une faible pression de collage, les électrodes peuvent être au nombre de quatre comme représenté sur la figure 3A. Pour des pressions plus importantes, on peut multiplier le nombre de paires d'électrodes comme représenté sur la figure 3B.

10

20

25

Revendications

- 1/ Dispositif de maintien électrostatique d'une plaquette de matériau conducteur ou semi-conducteur, composé d'une semelle électriquement isolante (1) sur laquelle est disposée ladite plaquette (2), d'au moins deux paires d'électrodes (7), (8), (9) et (10) les deux électrodes de chaque paire étant soumises à une différence de potentiel générée par une alimentation (6) fournissant une tension continue et créant ainsi un champ électrique intense, lesdites électrodes disposées sous la surface isolante, caractérisé en ce que les paires d'électrodes sont alimentées cycliquement sous des polarités différentes de manière à ce qu'à tout moment au moins une paire d'électrode maintienne la plaquette.
- 2/ Dispositif selon la revendication l caractérisé en ce que les électrodes sont des anneaux concentriques.
 - 3/ Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que la disposition des électrodes est symétrique ou concentrique par rapport au centre de la semelle (1).
 - 4/ Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les surfaces planes des deux électrodes formant une paire ont la même aire.
 - 5/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la surface de contact entre la plaquette et le dispositif de collage présente des variations géométriques (aspérités ou plots par exemple).

6/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que les électrodes et la couche de diélectrique (23) sont réalisées par sérigraphie de couches épaisses sur une plaque de base (22).

5

7/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un cycle d'alimentation des électrodes peut être le suivant :

De to à t1, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif.

10

20

25

De t1 à t2, l'électrode (7) est alimentée en positif et l'électrode (9) en négatif, l'électrode (8) en positif et l'électrode (10) en négatif.

A t2 les électrodes (7) et (9) n'ont plus besoin d'être alimentées puisque les électrodes (8) et (10) ont pris le relais.

De t2 à t3 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif.

De t3 à t4 l'électrode (8) est alimentée en positif et l'électrode (10) en négatif, les électrodes (7) et (9) sont de nouveau alimentées mais sous des polarités différentes qui permettront l'évacuation des charges.

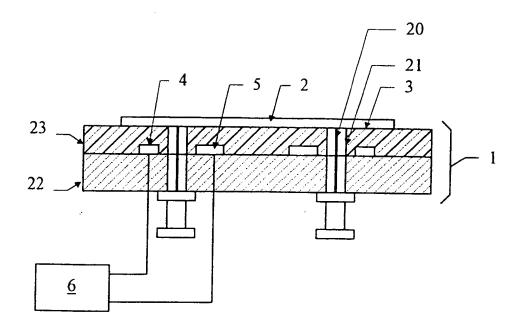
De t4 à t5 l'électrode (7) est alimentée en négatif et l'électrode (9) en positif.

Le cycle continue ainsi durant toute la phase de traitement ou d'usinage de la plaquette.

8/ Dispositif selon l'un des revendications précédentes caractérisé en ce que chaque électrode (7), (8), (9) et (10) est dédoublée.

9/ Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la fréquence de commutation des électrodes est comprise entre 0.01Hz et 1Hz.

1/4



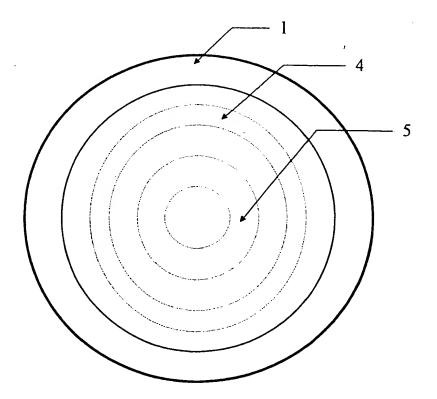


Figure 1

2/4

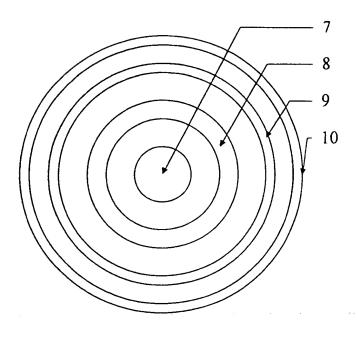


Figure 2A

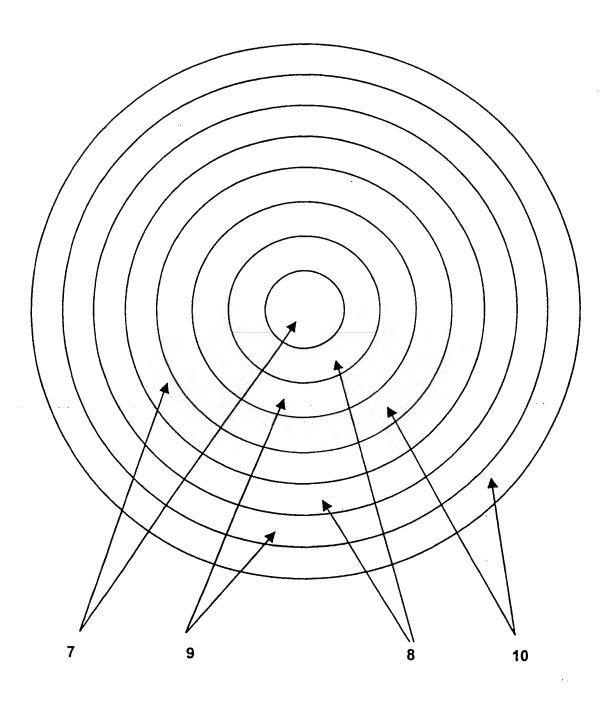


Figure 2B

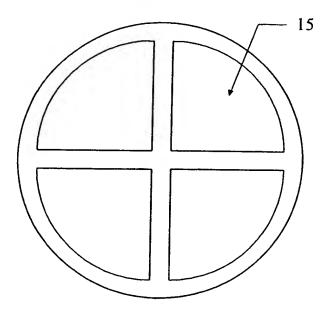


Figure 3A

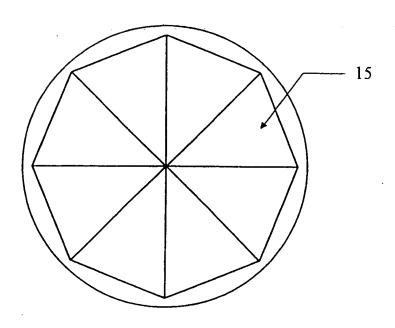


Figure 3B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ÎPC 7	H02N13/00 H01L21/68		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ication and IPC	
B. FIELDS	SSEARCHED		
Minimum d IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classificat H02N H01L	tion symbols)	
	ation searched other than minimum documentation to the extent that		
	data base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used	1)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	elevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 December 1988 (1988-12-14) column 1, line 41 -column 2, line	e 12	
Α	US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER AL) 9 February 1988 (1988-02-09) column 2, line 20 -column 2, line		
Α	EP 0 473 930 A (IBM) 11 March 1992 (1992-03-11) column 2, line 10 -column 2, line	e 53	
Α	US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD N 21 March 1995 (1995-03-21) column 5, line 8 -column 5, line		
		-/	
	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed	in annex.
	itegories of cited documents : ant defining the general state of the land which is not	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with	the application but
Conside	ered to be of particular relevance document but published on or after the international	cated to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the c	eory underlying the
"L" docume which i	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	be considered to cument is taken alone
"O" docume other n		cannot be considered to involve an in- document is combined with one or mo ments, such combination being obvious	ventive step when the pre other such docu-
rater (n		in the art. "&" document member of the same patent	
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
	8 February 2000	25/02/2000	
Name and m	nading address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Ramos . H	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No
PCT/FR 99/02767

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/FR 99	7/02/67
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		
	appropriate, or the relevant passages		Relevant to claim No.
A	US 5 001 594 A (BOBBIO STEPHEN M) 19 March 1991 (1991-03-19) abstract		
	<u>*</u>		
	(continuation of second short) (1.5.1.000)		

NATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

ational Application No PCT/FR 99/02767

				101711 33702707		
cite	atent document d in search report		Publication date		atent family nember(s)	Publication date
EΡ	0294556	Α	14-12-1988	JP	1768382 C	30-06-1993
				JP	4058274 B	17-09-1992
				JP	63257481 A	25-10-1988
				ΑT	87149 T	15-04-1993
				AT	87150 T	15-04-1993
				CA	1329637 A	17-05-1994
				CA	1329638 A	17-05-1994
				DE	3879281 A	22-04-1993
				DE	3879295 A	22-04-1993
				EP	0297227 A	04-01-1989
				US	4751609 A	14-06-1988
				US 	4864461 A	05-09-1989
US	4724510	Α	09-02-1988	NONE		
ЕP	0473930	A	11-03-1992	US	5055964 A	08-10-1991
				JP	6342843 A	13-12-1994
				JP	8017201 B	21-02-1996
				US	5099571 A	31-03-1992
 110	5400209		21 02 1005			
J	3400203	A	21-03-1995	US	5377071 A	27-12-1994
				US	5184398 A	09-02-1993
				JP	6177217 A	24-06-1994
US	5001594	Α	19-03-1991	WO	9103833 A	21-03-1991

RAPPORT DE RECEPCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 99/02767 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H02N13/00 H01L21/68 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la tois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) HO2N HO1L Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesqueis a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Catégorie ^a Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no, des revendications visées A EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 décembre 1988 (1988-12-14) colonne 1, ligne 41 -colonne 2, ligne 12 Α US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER B ET AL) 9 février 1988 (1988-02-09) colonne 2, ligne 20 -colonne 2, ligne 38 EP 0 473 930 A (IBM) Α 11 mars 1992 (1992-03-11) colonne 2, ligne 10 -colonne 2, ligne 53 Α US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M) 21 mars 1995 (1995-03-21) colonne 5, ligne 8 -colonne 5, ligne 38 Χl Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe Catégories spéciales de documents cités: T document ulterieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut document pouvant jeter un doute sur une revendication de être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 18 février 2000 25/02/2000 Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorise Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Ramos, H

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire F1 S26 34 B1 W01	POUR SUITE À DONNER	Voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)
Demande internationale n°	Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
PCT/FR 99/ 02767	10/11/1999	10/11/1998
Classification internationale des brevets (CI	B) ou classification nationale et	CIB
	H02N13/00	
Déposant		
SEMCO ENGINEERING SA et	al.	
Le présent rapport d'examen préli- international, est transmis au dépo Ce RAPPORT comprend	sant conformément à l'article 36.	'administration chargée de l'examen préliminaire sente feuille de couverture.
été modifiées et qui servent de l'administration chargée de l' Instructions administratives	de base au présent rapport ou de 'examen préliminaire internationa du PCT).	a description, des revendications ou des dessins qui ont feuilles contenant des rectifications faites auprès de il (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des
Ces annexes comprennent	·····	
3. Le présent rapport contient des in	dications relatives aux points sui	vants:
I X Base du rapport		
II Priorité		
III Absence de formulation industrielle	n d'opinion quant à la nouveauté	, l'activité inventive et la possibilité d'application
IV Absence d'unité de l'in	vention	
V X Déclaration motivée que citations et explications	uant à la nouveauté l'activité inve s à l'appui de cette déclaration	ntive et la possibilité d'application industrielle;
VI Certains documents cit	tés	
VII Irrégularités dans la de		
	à la demande internationale	
Date de présentation de la demande d'examinternational	men préliminaire Date	d'achèvement du présent rapport
23/05/2000		1 0. 08. 00
Nom et adresse postale de l'administration	chargée de l'examen Fonc	(67)
office Européen des Brevets D-80298 Munich Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 5 Fax: (+49-89) 2399-4465	i	P. Le Guay
Formulaire PCT/IPEA/409 (feuille de couve	erture) (juillet 1998) (17/07/20	00) SURICE ENTER



PCT/FR99/02767

I. Bas du rapp rt

1.				gé sur la base(Les feuilles de remplacement qui ont 14 sont considérées, dans la présente opinion, con	été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation nme "initialement déposées".;)
		X	la demande in	ternationale telle qu'initialement déposée	
			la description,	pages	, telles qu'initialement déposées
				pages	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				pages	, déposées sous couvert d'une lettre du
			les revendicat	ions n°s	, telles qu'initialement déposées
				n ^{os}	, telles que modifiées en vertu de l'article 19
				u _{os}	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				n ^{os}	, déposées sous couvert d'une lettre du
			les dessins,	feuilles / fig.	, telles qu'initialement déposées
				feuilles / fig.	, déposées avec la demande d'examen préliminaire internationale
				feuilles / fig.	, déposées sous couvert d'une lettre du
2.	Les mo	dificati	ions ont entraîn	é l'annulation	
			de la descripti	ion, pages	
			des revendica	ations, n ^{es}	
			des dessins, 1	feuilles / fig.	
3.				a été formulé abstraction faite (de certaines) des mo on tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans	difications, qui ont été considérées comme allant au-delà de le cadre supplémentaire (Règle 70.2 c)).

4. Observations complémentaires, le cas échéant :



Déclarati n motivée selon l'articl 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inv ntiv et la possibilité d'application industrielle ; citations et xplications à l'appui d cette d'claration

1. Déclaration

Nouveauté	Revendications	1-9	· OUI
	Revendications	Aucune	NON
Activité inventive	Revendications	1-9	OUI
	Revendications	Aucune	NON
Possibilité d'application industrielle	Revendications	1-9	OUI
	Revendications	Aucune	NON

2. Citations et Explications

1. Concernant la revendication 1:

- La revendication 1 se rapporte à un dispositif de maintien électrostatique du type a) comportant plusieurs paires d'électrodes alimentées par une tension continue.
- L'état de la technique le plus proche est représenté par le document EP-A-0294556 b) qui décrit un tel dispositif. Il comporte une paire d'électrodes. Le document en question a été introduit dans le préambule de la description et a servi de base pour délimiter la revendication 1.
- L'invention a pour but de faciliter le décollage de la plaquette de silicium après le c) traitement sans toutefois devoir mettre en oeuvre un système d'alimentation trop complexe.
- Le dispositif de maintien selon la revendication 1 se distingue de celui selon EP-Ad) 0294556 par la présence de plusieurs paires d'électrodes (au moins deux) alimentées cycliquement par des polarités différentes.
- Cette caractéristique est nouvelle par rapport au document de référence ; elle e) implique également une activité inventive car elle permet de résoudre le problème posé. Par conséquent, la revendication 1 satisfait aux exigences des articles 33(2) et (3) PCT.

2. Concernant les revendications 2 à 9 :

Ces revendications dépendent de la revendication 1 dont elles décrivent des formes particulières d'exécution.

Les revendications 2 à 9 sont donc également nouvelles et inventives au sens des articles 33(2) et (3) PCT.

3. La possibilité d'application industrielle du dispositif selon les revendications 1 à 9 est évidente.

VIII. Observati ns r latives à la demande int rnationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

La revendication 1 concerne un dispositif. Or il apparaît que l'unique caractéristique de sa partie caractérisante se rapporte à un procédé. La revendication 1 devrait donc être reformulée en revendication de procédé.

Il en va de même pour les revendications dépendantes, en particulier pour la revendication 7.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur :

L'ADMINISTRATION CHARGEE DE

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT

Destinataire

RAVINA Bernard RAVINA S.A. 24 Boulevard Riquet, BP 832, F-31080 Toulouse cédex 06 FRANCE

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(règle 61.1 DU PCT)

Date d'expédition (jour/mois/année)

1 0. 08. 00

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

F1 S26 34 B1 W01

PCT/FR 99/02767

NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale n°

Date du dépôt international (jour/mois/année) Date de priorité (jour/mois/année)

10/11/1999

10/11/1998

Déposant

SEMCO ENGINEERING SA et al.

- Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire internationale a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ses annexes.
- Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes, est transmise au Bureau international pour 2. communication à tous les offices élus.
- Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à 3. l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéresses.

RAPPEL 4.

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

> Office Européen des Brevets D-80298 Munich

Tel. (+49-89) 2399-0, Tx: 523656 epmu d Fax: (+49-89) 2399-4465

Fonctionnaire autorisé

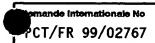


RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE	voir la notification de transi (formulaire PCT/ISA/220) e		
F1 S26 34 B1 W01	A DONNER	(IOIIIIIIIIII FOITIGALLY)	91, 10 Cas 60 10an 1, 10	pont a a-apies
Demande Internationale nº	Date du dépôt inte	emational(jour/mols/année)	(Date de priorité (la	a plus ancienne)
PCT/FR 99/02767	10/	/11/1999	(Jour/mols/année) 1 O	/11/1998
Déposant	10,	11/1///	10,	11/1//0
SEMCO ENGINEERING SA et a	.1.			
Le présent rapport de recherche Internati déposant conformément à l'article 18. Un	onale, étabil par l'ad le cople en est trans	ministration chargée de la re mise au Bureau internationa	echerche Internation	ale, est transmis au
				•
Ce rapport de recherche internationale co		feuilles.		
X II est aussi accompagné	d'une copie de chaq	ue document relatif à l'état d	le la technique qui y	est cité.
Base du rapport				
a. En ce qui concerne la langue, la langue dans laquelle elle a été dé	recherche Internatio posée, sauf Indicati	nale a été effectuée sur la b on contraire donnée sous le	ase de la demande même point.	Internationale dans la
la recherche International	le a été effectuée su	r la base d'une traduction de	e la demande interna	ationale remise à l'administration.
 b. En ce qui concerne les séquences la recherche internationale a été é 	es de nucléotides d	xu d'acides aminés divulgu	ées dans la demand	de internationale (le cas échéant),
contenu dans la demande		•	•	
déposée avec la demand	e internationale, sou	is forme déchiffrable par ord	lnateur.	
remis uitérieurement à l'a	idministration, sous f	orme écrite.		
remis uitérieurement à l'a	idministration, sous f	forme déchiffrable par ordina	ateur.	
La déclaration, selon laque divulgation faite dans la d	ielle le listage des se lemande telle que dé	áquences présenté par écrit áposée, a été fournie.	et fourni ultérieuren	ient ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laque du listage des séquences	uelle les informations s présenté par écrit, s	enregistrées sous forme dé à été fournie.	échiffrab le par ordina	ateur sont identiques à celles
2. 📗 II a été estimé que certa	ines revendication	s ne pouvaient pas faire l'e	objet d'une recher	che (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité de	i'invention (voir le	cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre,				
X le texte est approuvé tel d	qu'il a été remis par i	e déposant.		
Le texte a été étabil par l'	administration et a la	a teneur sulvante:		
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
le texte est approuvé tel c	•	•		
le texte (reproduit dans le présenter des observation de recherche internations	ns à l'administration	oli par l'administration confon dans un délai d'un mois à co	mément à la règle 3 ompter de la date d'o	8.2b). Le déposant peut expédition du présent rapport
6. La figure des dessins à publier avec		on o°	1	
X suggérée par le déposant	t.			Aucune des figures
parce que le déposant n'a	a pas suggéré de fig	ure.	 -	n'est à publier.
parce que cette figure car	ractérise mieux l'inve	ention.		

RAPPORT DE RECHEINTERNATIONALE



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H02N13/00 H01L21/68

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification sulvi des symboles de classement) CIB 7 H02N H01L

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisée)

C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 294 556 A (ABISARE KK) 14 décembre 1988 (1988-12-14) colonne 1, ligne 41 -colonne 2, ligne 12	
A	US 4 724 510 A (LACHENBRUCH ROGER B ET AL) 9 février 1988 (1988-02-09) colonne 2, ligne 20 -colonne 2, ligne 38	
A	EP 0 473 930 A (IBM) 11 mars 1992 (1992-03-11) colonne 2, ligne 10 -colonne 2, ligne 53	
A	US 5 400 209 A (MOSLEHI MEHRDAD M) 21 mars 1995 (1995-03-21)	
	colonne 5, ligne 8 -colonne 5, ligne 38	

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais	T" document ufférieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mals cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
18 février 2000	25/02/2000
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5618 Patentiaan 2	s Fonctionnaire autorisé
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Ramos, H

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

emande Internationale No PCT/FR 99/02767

Catégorie °	CUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents	no. des revendications visées
	US 5 001 594 A (BOBBIO STEPHEN M) 19 mars 1991 (1991-03-19) abrégé	
)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

	nternational	Application No	
Y	PCT/FR	99/02767	

	atent document d in search report	: :	Publication date		atent family member(s)	Publication date
EP	0294556	A	14-12-1988	JP	1768382 C	30-06-1993
				JP	4058274 B	17-09-1992
				JP	63257481 A	25-10-1988
				AT	87149 T	15-04-1993
				AT	87150 T	15-04-1993
				CA	1329637 A	17-05-1994
				CA	1329638 A	17-05-1994
				DE	3879281 A	22-04-1993
				DE	3879295 A	22-04-1993
				EP	0297227 A	04-01-1989
				US	4751609 A	14-06-1988
				US	4864461 A	05-09-1989
US	4724510	Α	09-02-1988	NONE		
EP	0473930	A	11-03-1992	US	5055964 A	 08-10-1991
				JP	6342843 A	13-12-1994
				JP	8017201 B	21-02-1996
				US	5099571 A	31-03-1992
US.	5400209		21-03-1995	US	5377071 A	27-12-1994
				ÜŠ	5184398 A	09-02-1993
				JP	6177217 A	24-06-1994
	5001594	A	19-03-1991	 WO	9103833 A	



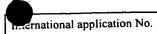


PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

			C. Taraniani of International		
Applicant's or agent's file reference F1 S26 34 B1 W01	FOR FURTHER ACTIO	ON Preliminary	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (a		Priority date (day/month/year)		
PCT/FR99/02767	10 November 1999	9 (10.11.99)	10 Novemer 1998 (10.11.98)		
International Patent Classification (IPC) or H02N 13/00	national classification and IF	PC	RECEIVE AUG 24 20 2800 MAIL		
Applicant	SEMCO ENGINE	ERING S.A.	ROOF		
Authority and is transmitted to the	applicant according to Artic	16 36.	International Preliminary Examining		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.					
· ·			AUG 2 1 2001		
3. This report contains indications re	lating to the following items	:			
I Basis of the repo		٦	TECHNOLOGY CENTER R3700		
II Priority					
··· 🗀		novelty, inventive	step and industrial applicability		
IV Lack of unity of			1		
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty citations and explanations supporting such statement			, inventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents cited VII Certain defects in the international application					
			California		
Date of submission of the demand	1	Date of completion	n of this report		
23 May 2000 (23.0)5.00)	10	August 2000 (10.08.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/E	IP .	Authorized officer			
Facsimile No		Telephone No.			



• PCT/FR99/02767

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of the		, ,	
1. This report under Article	has been drawn of	n the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed" of	which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
\bowtie	the international	application as originally filed.	
	the description,	pages	, as originally filed,
لــا		pages	, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of,
		pages	, filed with the letter of
	the claims,	Nos	, as originally filed,
ليا		Nos	, as amended under Article 19,
		Nos	
		Nos	, filed with the letter of,
٠		Nos.	, filed with the letter of ·
	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,
		sheets/fig	
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,
		sheets/fig	, filed with the letter of ·
2. The ameno	iments have result	ted in the cancellation of:	
		pages	
	the claims,	Nos	İ
	the drawings,	sheets/fig	
3. Thi	s report has been on beyond the disc	established as if (some of) the an closure as filed, as indicated in th	nendments had not been made, since they have been considered e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
	,		
4. Additiona	l observations, if	necessary:	
İ			
\			
1			

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I ational	application No.
PCT/FR	99/02767

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

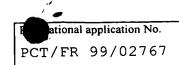
. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-9	YES
	Claims	None	NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
	Claims	None	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
•	Claims	None	NO

2. Citations and explanations

1. Concerning Claim 1:

- a) Claim 1 relates to an electrostatic holding device comprising a plurality of pairs of electrodes powered by direct current.
- b) The closest prior art is document EP-A-0294556 which describes a device of this kind. Said device comprises one pair of electrodes. This document is cited in the introductory part of the description and constitutes the basis for the delimitation of Claim 1.
- The aim of the invention is that of facilitating the release of the silicon wafer after treatment without having to use a power supply system that is too complex.
- d) The holding device as per Claim 1 differs from the device as per EP-A-0294556 by virtue of the presence of a plurality of pairs of electrodes (at least two) powered cyclically by different polarities.
- e) This feature is novel over the reference document.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



It also involves an inventive step, as it solves the stated problem. It follows that Claim 1 fulfils the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

2. Concerning Claims 2 to 9:

These claims are dependent on Claim 1 and describe specific embodiments of the device thereof.

It follows that Claims 2 to 9 are also novel and inventive under the terms of PCT Article 33(2) and (3).

3. The industrial applicability of the device as per Claims 1 to 9 is obvious.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



VIII. Certain observations on the international application,

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claim 1 relates to a device. However, the sole feature of the characterising portion of said claim appears to relate to a method. Claim 1 should therefore be redrafted as a method claim.

The same is true of the dependent claims, particularly Claim 7.